

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和3年7月26日(2021.7.26)

【公開番号】特開2019-121784(P2019-121784A)

【公開日】令和1年7月22日(2019.7.22)

【年通号数】公開・登録公報2019-029

【出願番号】特願2018-206819(P2018-206819)

【国際特許分類】

H 01 L 21/3213 (2006.01)

H 01 L 21/768 (2006.01)

H 01 L 21/302 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/88 D

H 01 L 21/302 201 A

【手続補正書】

【提出日】令和3年5月24日(2021.5.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0036

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0036】

図9中55はウエハWの搬送口であり、側壁本体部53において上記の成膜ガスが衝突する部位とは処理容器51の周方向に離れた部位に開口し、上記のゲートバルブ43により開閉自在に構成されている。図中66は処理容器51の底面に開口した排気口であり、排気管を介して真空ポンプ及びバルブなどにより構成される排気機構67(図8参照)に接続されている。排気機構67による排気口66からの排気流量が調整されることにより、処理容器51内の圧力が調整される。